自動光學檢測設備聯盟
Automatic Optical Inspection Equipment Association

AOIEA 網站「廣告刊登服務」申請書

□**本公司完全同意以下處理原則**

(1)廣告內容須具有 AOI 高度關聯性

(2)委託者願意接受 AOIEA 廣告格式，AOIEA 擁有最終編輯權

(3)委託者須自行準備圖檔(300x250px/5M 內)並提交秘書處審核，AOIEA 有權利決定是否提供刊登服務

(4)完成網站廣告刊登並上架後，將會不定期於 AOIEA 電子報上同步曝光

(5)費用資訊如下：**未稅價**，發送期限以上架月起計算，並以季為單位，下架日為當季最後一日

項　　目	VIP 會員	團體會員	一般會員	免費會員
網站刊登	$12,000/季	$18,000/季	$22,000/季	$24,000/季

基 本 資 料 (必填)				
公司名稱	(中文)		**統一編號**	
會員級別	□ VIP 會員　□ 團體會員　□ 一般會員　□ 免費會員　□ 加入會員			
聯絡人	**姓　　名**		**職　　稱**	
	公司電話	**分機**	**行動電話**	
刊登需求	□ 1 季　□ 2 季　□ 3 季　□ 全年(享 85 折)		**刊登期間**	年　月 ~　年　月
刊登費用	總計 $_____**(未稅)**		**申請日**	年　月　日
匯款資訊	■ 費用繳納方式：□ 銀行匯款 □ ATM 轉帳，完成付款後，請主動來電或來信告知秘書處 ■ 委託者請於申請後 2 週內完成付款，若有相關疑慮歡迎致電秘書處 ■ **金融作業手續費、營業稅 5%由繳款方處理**，實際金額以開立發票為主，敬請足額付款 ■ 匯款帳戶：財團法人工業技術研究院；帳號：(代號 005)台灣土地銀行工研院分行 156-005-00003-3；請於備註欄註明『AOIEA 廣告刊登』 ■ 諮詢：圖檔-劉小姐 03-573-2285 / cs1108@itri.org.tw / 發票-李小姐 03-573-2100 / lizzie@itri.org.tw ■ 相關資訊請見 AOIEA 自動光學檢測設備聯盟			

個資同意書

依據個資法蒐集、處理及利用您的個人資料包含識別個人姓名、行動電話、電子郵件等。上述個人資料之蒐集、處理及利用，將僅限本聯盟業務需要使用，並遵守個資法之規定妥善保護您的個人資訊。依據個資法第 3 條規定，您可向本聯盟行使之個資權利包括：查詢、 閱覽、複製、補充、更正、處理、利用及刪除。您可以選擇是否提供個資，惟若選擇不提供或是提供不完整，將無法完成廣告刊登服務申請。

□ **本人經聯盟告知《個人資料保護法》相關事項，已清楚瞭解蒐集、處理或利用本人個人資料之應告知事項並同意該聯盟使用。**

填表人：_____　　**單位印鑑章：**_____

填表人印鑑：_____　　**填表日期：**_____

※ 網站廣告區域


全網搜尋...
聯絡AOIEA
訂閱電子報
廣告服務
會員登入
自動光學檢測設備聯盟
Automatic Optical Inspection Equipment Association
關於聯盟
活動看板
產經情報
論壇專區
技術鏈結
廠商名錄
網站連結
工研院攜產學研聚焦先進半導體、矽光子智慧檢測
2026 第二十六屆全國AOI論壇與展覽
最新產業情報
MORE +
2026-10-16
ETEL推出METIS HP高精度半導體掃描平台
ETEL推出METIS HP全氣浮平面運動平台，鎖定步進掃描、直接雷射寫入與高解析光學檢測。平台以高精度定位及穩定運動支援先進半導...
2026-10-15
數位顯微導入產線的實務重點與效益
Quality Magazine整理數位顯微導入現有產線的實務條件，包括影像品質、視野、工作距離及是否需要雙眼立體視覺。文章並指出...
2026-10-15
ZEISS推進次世代半導體檢測與量測方案
ZEISS發表先進封裝與光罩檢測布局，NLX可非破壞觀察堆疊晶粒內部連接，DUNE量測並修正晶圓翹曲；AIMS EUV 3.0則模...
2026-10-14
3DAR技術動態控制雙光子3D列印體素
UpNano推出3D Adaptive Resolution技術，可在雙光子聚合3D列印過程中即時調整體素在三個空間方向的尺寸與形...
近期活動訊息
MORE +
目前暫無近期活動訊息。
最新技術鏈結
MORE +
財團法人工業技術研究院/量測技術發展中心 | 2026-08-11
光譜式反射儀量測技術
薄膜厚度量測 Thin film thickness measurement 厚膜厚度量測 Thick film thick...
財團法人工業技術研究院/量測技術發展中心 | 2026-09-14
晶圓疊對量測技術
晶圓疊對偏差量測 Wafer Overlay 關鍵尺寸量測 Critical Dimension Measurement
財團法人工業技術研究院/量測技術發展中心 | 2026-09-15
晶圓表面形貌量測技術
晶圓翹曲及薄膜應力量測 Wafer warpage/Bow/Film stress 矽、碳化
推薦廠商 / 贊助廣告
2026 第二十六屆
活動日期：2026.10.1 (四)
舉辦地點：新竹陽明交大電資大樓
VIP 會員
廣告輪播區
團體會員
廣告輪播區
立即洽詢刊登方案 ›
一般會員
廣告輪播區
免費會員
廣告輪播區
Copyright ©2026 自動光學檢測設備聯盟 (AOIEA)